

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第1区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2004-532733(P2004-532733A)

【公表日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【年通号数】公開・登録公報2004-042

【出願番号】特願2003-510136(P2003-510136)

【国際特許分類】

**B 01 D 33/17 (2006.01)**

**B 30 B 9/20 (2006.01)**

**C 02 F 11/12 (2006.01)**

**B 01 D 33/58 (2006.01)**

**B 01 D 33/80 (2006.01)**

【F I】

B 01 D 33/24 Z A B

B 30 B 9/20 C

C 02 F 11/12 D

B 01 D 33/34

【手続補正書】

【提出日】平成17年7月5日(2005.7.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

湿った塊を圧縮することによって脱水する装置であつて、

液体を除去するための脱水通路と、負荷測定装置と、を有し、

前記脱水通路は、湿った塊を供給するための供給口と、湿った塊に含まれている液体を排出させるための穴が設けられた回転式のスクリーンと、湿った塊を圧縮することによって得られたケーキ状の脱水された塊を排出するための排出口と、を有し、

前記排出口には、ケーキ状の脱水された塊を押さえつけ、或いは、解放する動作を行うレストリクターが取り付けられ、

前記レストリクターは、アクチュエータによって垂直方向或いは横方向へ動作するよう構成されており、

前記負荷測定装置によって計測された負荷の値に基づいて、前記スクリーンの回転速度、前記アクチュエータの負荷、前記レストリクターの位置、及び／又は、前記供給口における供給圧力が制御されるように構成されていることを特徴とする脱水装置。

【請求項2】

湿った塊を圧縮することによって脱水する装置であつて、

液体を除去するための脱水通路と、負荷測定装置と、圧力センサーと、を有し、

前記脱水通路は、湿った塊を供給するための供給口と、湿った塊に含まれている液体を排出させるための穴が設けられた回転式のスクリーンと、湿った塊を圧縮することによって得られたケーキ状の脱水された塊を排出するための排出口と、を有し、

前記排出口には、ケーキ状の脱水された塊を押さえつけ、或いは、解放する動作を行うレストリクターが取り付けられ、

前記レストリクターは、アクチュエータによって垂直方向或いは横方向へ動作するよう

に構成されており、

前記負荷測定装置によって計測された負荷の値、及び、前記圧力センサーによって計測された圧力の値に基づいて、前記スクリーンの回転速度、前記アクチュエータの負荷、前記レストリクターの位置、及び／又は、前記供給口における供給圧力が制御されるように構成されていることを特徴とする脱水装置。